

技術講習会

分光エリプソメーター(屈折率・膜厚測定装置)

当研究所では、公益財団法人 JKA の平成 29 年度公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業により「分光エリプソメーター」を導入しました。分光エリプソメーターは、**材料の屈折率や消衰係数、薄膜の膜厚を非破壊で精度良く測定することができる装置**です。この度、その特徴をより具体的にご理解いただき、ご利用の一助となることを目的として、本装置の**初心者向け技術講習会**を下記の要領で開催いたしますので、ご案内申し上げます。

◆日 時：令和元年 12月17日(火) ①9:45~11:45 ②13:15~15:15

①、②とも同じ内容の講習を行います。ご希望の時間帯をお選び下さい。

(バスでお越しの場合、①は9:27 ②は12:54 に和泉中央駅を出発するバスで間に合います。)

○当研究所内に食堂がございます。一般の方もご利用になれます。(営業時間：11:45~13:15)

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター (和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。

担当者が講習会場にご案内します。(受付は講習会開始時間の10分前より始めます。)

◆定 員：各コース(①、②)とも1社のみ。参加人数は、1社3名まで。

※ 受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 顧客サービス部

※ お申込みは、メール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2520) でお願います。

◆対象機器：分光エリプソメーター (M-2000UI)

H29年度JKA機械設備拡充補助事業により導入しました分光エリプソメーター(M-2000UI) を用いた**初心者向け**の講習を開催します。本講習では、エリプソメーターの原理を説明した後、機器の概要説明を行います。その後、実習用試料の屈折率や膜厚等を測定することにより、装置の操作方法を説明します。なお、本講習会では、受講者による持ち込み試料の対応はいたしません。



機器型番：M-2000UI

ジェー・イー・ウーラム・ジャパン株式会社

◆講習担当：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター

電子・機械システム研究部 佐藤和郎

・お問い合わせ先：顧客サービス部 TEL：0725-51-2518

